

走査電子顕微鏡 S-3500H

製造元	株式会社日立ハイテク 購入年度：1998年度
仕様	熱電子銃（タンダステン、最高加速電圧 30kV）、二次電子検出器、エネルギー分散型 X 線分析装置、波長分散型 X 線分析装置
保有部署	材料工学専攻
設置場所	吉田・工学部物理系校舎・地下1階 002 室
利用期間・時間、 利用料金	本設備の共同利用規程を参照 https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/20210210-zaiko
注意事項等	事前講習を受講のうえ、利用者自身で測定してください。 利用目的、試料情報（導電性の有無、組成、形状、個数）を下記連絡先にお知らせください。
連絡先	材料工学専攻 教育研究支援室 技術職員 佐々木 宣治 075-753-5426 sasaki.nobuharu.7a@kyoto-u.ac.jp
キーワード	SEM、EDX、WDX、EPMA
機器コード	0000103003
自由記入欄	固体表面の組織観察や組成分析を行う熱電子銃搭載の走査電子顕微鏡です。分解能 100nm 程度の二次電子像観察、Na 以降の元素を対象とする検出下限 0.1at.%程度、X 線発生領域 1 μ m 程度の EDX 分析、B 以降の元素を対象とする検出下限 0.01at.%程度、X 線発生領域 1 μ m 程度の WDX 分析が可能です。

令和6年10月10日現在

